

日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会
委員総会議事次第

日時 2020年6月26日（金） 13:00～13:15
場所 Web会議

- 議題
1. 委員動静・幹事構成について
 2. 2019年度予算収支報告と2020年度予算案について
 3. 2020年度の研究会企画について
 4. 2020年度ハワイシンポジウムについて
 5. 2021年度のDRIPについて
 6. その他

- 配付資料
1. 第9期委員名簿
 2. 令和元年度決算-2年度予算報告

今年度予定

【定例研究会】

- (1)(1) 第168回「マテリアルズ・計測インフォマティクスの最前線」2020年6月26日
世話人：*宇佐美、杳掛
- (2) 第169回「先端デバイスに開発に貢献する分析・評価技術」2020年6月以降
世話人：*泉妻、佐俣、小椋
- (3) 第170回「Si-IGBT」2020年の9-10月頃
世話人：*西澤、佐俣、泉妻
- (4) 第171回「ワイドギャップ半導体のp型制御関連」2021年の1-2月頃
世話人：*末岡、太子
- (5) 第172回「加工関係」2021年の1-2月頃
世話人：*佐野

【国際シンポジウム】

第8回シリコン材料の先端科学と技術国際シンポジウム(<http://gakushin145.kir.jp/hawaii2020/>)
The 8th International Symposium on Advanced Science and Technology of Silicon Materials (2020)
実行委員長 末岡 浩治

【国際シンポジウム】

19th International Conference on Defects-Recognition, Imaging and Physics in Semiconductors (DRIP XIX)
開催日：2021年11月7日-11日
場所：横浜
実行委員会委員長：土田秀一，関口隆史

【国内シンポジウム】

パワーデバイス Si 研究会
実行委員会委員長：石川由加里

第145委員会のHP：<https://www.riam.kyushu-u.ac.jp/nano/gakushin145/>